

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成30年9月6日 (2018.9.6)

【公表番号】特表2017-538102(P2017-538102A)
 【公表日】平成29年12月21日 (2017.12.21)
 【年通号数】公開・登録公報2017-049
 【出願番号】特願2017-518136(P2017-518136)
 【国際特許分類】

G 0 1 B 11/00 (2006.01)

G 0 1 N 21/88 (2006.01)

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 B 11/00 G

G 0 1 N 21/88 Z

H 0 1 L 21/66 J

【手続補正書】
 【提出日】平成30年7月26日 (2018.7.26)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】請求項 2
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【請求項 2】

前記干渉計装置 (3 0) が 光導波路 を備える集積光学装置であり、前記 光導波路 の入力部が前記光源に結合され、前記 光導波路 が 2 つの分岐に分割され、前記 光導波路 の出力部が、前記 2 つのビームの交差点に前記測定体積を形成するために方向付けられる、請求項 1 に記載の方法。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 7 1
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 7 1 】

別の実施形態によれば、図 3 A および図 6 A に示すように、測定体積は、ウェハ 2 の主表面 S の垂線に対して角度 で傾けられる。